

大分大学工学部基盤技術支援センター説明会のご案内

大分大学工学部では大学における教育・研究の技能・技術面からの支援にとどまらず、地域企業への技術開発支援・技術者支援にも対応できるように「基盤技術支援センター」を組織しました。このたび下記日程にて地域の皆様方に本センターの概要を説明すると同時に、新たに導入されましたマシニングセンタと3Dプリンタの技術説明を行う機会を設けることとなりました。新年度へ向け、ご多用のことと思いますが、ぜひ万障お繰り合わせのうえご参加くださいますようお願い申し上げます。

【日時】：平成27年3月27日（金）、13：00～

【本会場】：産学官連携推進機構 セミナー室

13：00～

(1) 開会挨拶及び概要説明（於 産学官連携推進機構 セミナー室）

①挨拶：産学官連携推進機構副機構長（工学部教授）

井上 正文（福祉環境工学科建築コース）

②概要説明：工学部基盤技術センター長（工学部教授）

田上 公俊（機械・エネルギーシステム工学科 機械コース）

13：30～

(2) 導入機器説明

①5軸制御立形マシニングセンタ OKUMA・MU-400V II

オークマの智能化技術についてオークマ技術者による紹介

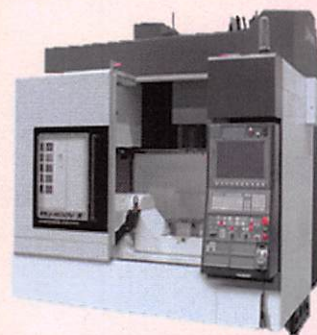
- ・ サーモフレンドリー（素直な熱変位を正確に制御）
- ・ ファイブチューニング（幾何誤差を計測・補正）
- ・ 加工ナビ（加工条件検索機能）
- ・ アンチクラッシュ（衝突防止機能）

◆ 実機での機能・仕様説明（場所：基盤技術支援センター）

②3Dプリンタ（概要およびサンプル紹介）

Stratasys・FORTUS 250mc

※時間は予定で、進行により変更の場合があります。



【参加方法】

- ◇ 参加希望の場合、（氏名、所属、メールアドレス）を、「電子メール」か「FAX」にて下記事務室までお送りください。
- ◇ 当日参加も可能ですが、講演資料の準備の都合がありますので、現時点でご参加ご希望の方は、ぜひお申し込みをお願いします。

連絡先：大分大学工学部機械・エネルギーシステム工学科 機械教室（事務担当：篠田）

TEL:097-554-7763, FAX: 097-554-7764, e-mail: meoffice@oita-u.ac.jp

機械教室 web: <http://machls.cc.oita-u.ac.jp>